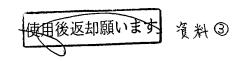
Japanese Unexamined Utility Model Application Publication No. S60-120340

The present device provides a semiconductor type pressure sensor. The sensor includes a metallic pressure introduction cylinder and a plastic casing. The cylinder is inserted into the casing. The cylinder has a Bulge shape, for preventing the cylinder from rotating. The Bulge shaped cylinder has at least two concavities.



公開実用 昭和60- 120340

⑲日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭60-120340

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月14日

G 01 L 19/00

7507-2F

審査請求 未請求 (全 頁)

😕考案の名称 半導体式圧力センサ

ᡚ実 顧 昭59−7655

❷出 顧 昭59(1984)1月25日

砂考案者 栗田 正弘 砂考案者 仲沢 昭美

砂考案者 高 橋 実

勝田市大字高場2520番地 株式会社日立製作所佐和工場內 勝田市大字高場2520番地 株式会社日立製作所佐和工場內 勝田市大字高場2520番地 株式会社日立製作所佐和工場內

①出 順 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫代 瓘 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

明 糆 鹄

考案の名称 半導体式圧力センサ 実用新案登録請求の範囲

1. 金属の圧力導入管をインサートしたプラスチックケースを有する半導体式圧力センサにおいて、 5前記圧力導入管の回転防止として、バルジ形状とし、かつ、バルジ形状を少なくとも 2 ケ所以上、凹形とした圧力導入管を有するプラスチックケースを用いたことを特徴とする半導体式圧力センサ。 考案の詳細な説明

〔考案の利用分野〕

本考案は、半導体圧力センサに係り、特に、プラスチツクケースにインサートされた圧力導入管が回転し、圧力リークすることを防止するものに関する。

〔考案の背景〕

従来、圧力導入管の回転防止法として、圧力導入管をパルジ形状にしている。回転防止法として、 パルジ形状を第1図の点線で示す様に大きくする ことが望ましいが、この形状にすると、圧力導入

(1)

20

15

10



公開実用 昭和60- 120340

管に亀裂が生じてしまうため、パルジ形状の大き さに限界があり、現行の形状では、圧力導入管が 回転してしまい、圧力リークが発生する問題があ る。

(考案の目的)

本考案の目的は、圧力導入管のバルジ部に凹形状を少なくとも2ケ以上設けて、回転防止に優れた半導体圧力センサを供給することにある。

〔考案の概要〕

本考案は、圧力導入管の防止法として、圧力導 入管にバルジを設け、そのバルジ形状を凹形状と したものである。

〔考案の実施例〕

次に本考案の実施例について説明する。第2図は、本考案による半導体圧力センサの断面図を示す。圧力を電気信号に変換するゲージクミーとその演少出力電圧を増幅するハイブリッド日C2をプラスチックケース3に接着する。ここで、プラスチックケースには、圧力をゲージクミーに導入するための金属圧力導入管4をインサートしてあ

(2)

20

る。圧力導入督 4 には、バルジ形状としてあり、 さらに、凹部を 2 箇所設けてある。

〔考案の効果〕

本考案によれば、圧力導入管にゴムパイプなど を挿入する際に加えられる力で、回転してしまい プラスチックと圧力導入管の境界より圧力リーク するのを防止するのに効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は、従来のプラスチツクケースの断面図、 第2図は、水考案の半導体圧力センサの断面図を 10 示す。

1 … ゲージクミ、 2 … ハイブリツド I C 、 3 … ブラスチツクケース、 4 … 圧力導入管。

代理人 弁理士 高橋明夫

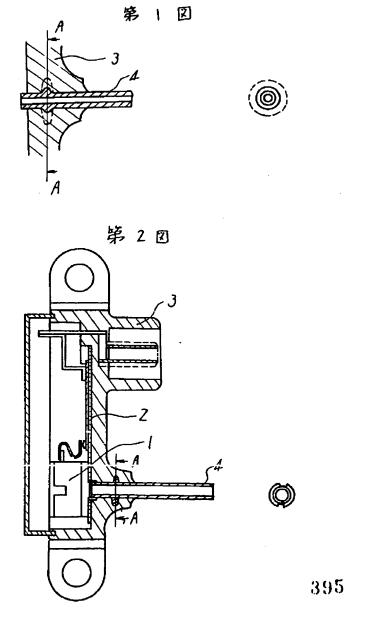


. .



20

公開実用 昭和60- 120340



代理人 高 橋 明 夫 业階(A-101311)